## 114年「半導體製程設備實務技術教師研習營」課程表

課程日期:114年8月21(四)~8月22日 (五)

課程地點:國立高雄科技大學楠梓校區大仁樓半導體製程設備實務人才培育基地

(高雄市楠梓區海專路 142 號) (集合地點:大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)

報名 QR CODE

課程內容: 半導體製程設備實務技術

參與對象:全國在職之技專校院教師、高中職教師/預計招收實體 30 人

報名網址: https://forms.gle/ABCKgjRCAK14GbUN9

課程表:



日期	時間	課程單元主題/內	內容/授課教師	
8/21	08:45-09:00			
(四)		(集合地點:大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)		
	09:00-12:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學	員為主,輪流施作不同課程)	
		1.半導體製程設備基地中心介紹	國立高雄科技大學半導體工程系 楊奇達系主任	
		2.半導體產業應用與製程介紹	李重義教授	
		3.半導體設備工程師通用技能	唐健富助理教授	
		Loadport、真空管件、氦氣測漏儀	陳玉鴻助理教授	
	12:00-13:00	午 餐		
		(午休地點:大仁樓五樓 6504 階梯教室)		
	1300-17:00	課程分 A、B-2組(每組以 15位學員為主,輪流施作不同課程)		
		<b>尘 道 雕 凯 从 二 从 洋 枷 韵 入 瘁 功 。</b>	國立高雄科技大學半導體工程系	
		半導體設備元件儀控整合實務:	葉旻彦教授	
		加熱載台、真空系統、曝光機機構 和程控、機械手臂等	姚永正助理教授	
		和在控、機械丁月子	侯杰利助理教授	
	17:00-18:00	技術交流 Q&A		
8/22	08:45-09:00	報 到		
(五)		(集合地點:大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)		
上午	09:00-12:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學員為主,輪流施作不同課程)		
		A 組	B組	
		半導體真空系統實務:	半導體黃光微影製程實務:	
		真空系統元件功能介紹、高真空系	曝光機實務製作、乾蝕刻實作	
		統操作實務、真空系拆解統與組		
		裝、真空系統測漏實務		
		國立高雄科技大學半導體工程系	國立高雄科技大學半導體工程系	
		王俊凱副教授	楊奇達系主任	
		陳玉鴻助理教授	唐健富助理教授	
		張勝博助理教授	<b>侯杰利助理教授</b>	

	12:00-13:00	午 (午休地點:大仁樓五	餐 樓 6504 階梯教室)
日期	時間	課程單元主題/內容/授課教師	
8/22	13:00-17:00	課程分 A、B 組(每組以 15 位學員為主,輪流施作不同課程)	
(五)		半導體黃光微影製程實務:	半導體真空系統實驗室(6104):
下午		曝光機實務製作、乾蝕刻實作	真空系統元件功能介紹、高真空
			系統操作實務、真空系拆解統與
			組裝、真空系統測漏實務
		國立高雄科技大學半導體工程系	國立高雄科技大學半導體工程系
		楊奇達系主任	王俊凱副教授
		唐健富助理教授	陳玉鴻助理教授
		侯杰利助理教授	張勝博助理教授
	17:00-18:00 技術交流 Q&A		Q&A
		(集合地點:大仁樓一樓 6104 半導體通用技能實驗室)	

## 大仁樓一樓6104階梯教室



## 《位置圖》